

SAICAS Application Note

斜め切削断面での化学分析測定 ② ～ ケミルミネッセンス ～

資料番号:SC0004 / 公開日:2021.01.12

<概要>

近年高分子の劣化評価技術として、一般化しつつあるケミルミネッセンス(化学発光)測定にCCDカメラと組み合わせたイメージング測定技術があり、酸化劣化を可視化することが可能となっている。

そこで今回は、耐候劣化PC樹脂においてSAICASによる斜め切削断面でのケミルミネッセンス(酸化劣化)のイメージング測定事例を紹介する。

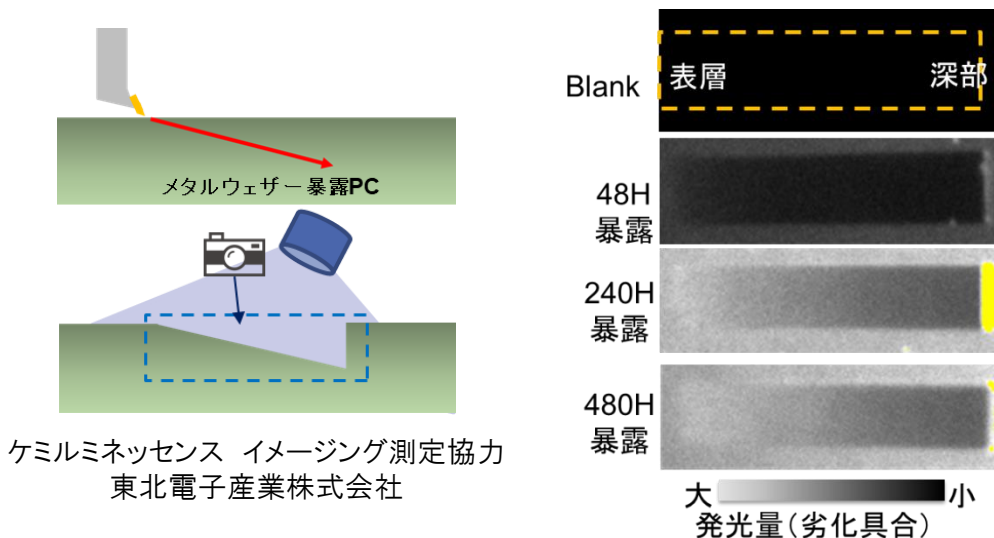
<試験>

試験体：ポリカーボネート(PC)樹脂 未劣化1種
メタルウェザー(DMW)劣化 3水準(48h 240h 480h)

試験装置：SAICAS EN型

切刃：ダイヤモンド切刃 (刃幅0.3mmスクイ角20° ニゲ角10° C面)

<結果>



測定結果に関するお問い合わせは、dawin@wintes.co.jpまで